

Ausstattung am Standort Zweibrücken Reinraum

Mikro- und Nanostrukturierung

- Mask- and Bond-Aligner (Karl Süss KG, MA/BA6)
- Maskless Aligner (Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH, μ MLA)
- Nanoimprintanlage (Obducat AB, Eitre 6)

Dünnschichttechnik und Metallisierung

- Aufdampfanlage (Balzers, BAK 500)
- Sputteranlage (Leybold, Z590-S)
- Hochtemperaturofen (Inotherm Industriewärmegeräte GmbH, DA 1200 4 150 3Z)
- PECVD (Sentech Instruments GmbH, Depolab 200)
- Rapid Thermal Processing (Annealsys, As-One 150)
- Gold-, Nickel- und Legierungsgalvanik (Fa. M.O.T.)



Ätzen und Reinigen

- HF-Ätzen (gepuffert, 1 % und 6 %, Arias)
- KOH-Ätzen (Arias)
- Carosche Reinigung (Arias)
- Ultraschall-/Megashallbecken (Arias)
- Plasmastripper (Diener Electronic, Tetra 30)
- RIE (Sentech Instruments GmbH, SI 591)
- ICP-RIE mit Laserinterferometer (Sentech Instruments GmbH, SI 500 C; SLI 670)

Präparation

- Spin-Coater (Reinraumtechnik Lanz, EBS 10)
- Spin-Coater (Süss MicroTec SE, Labspin8)
- Spin-Coater (APT GmbH, POLOS SPIN150i)
- Hotplate (Reinraumtechnik Lanz, HP150)
- Hotplate (Süss MicroTec SE, HP8)
- Vakuumofen (Heraeus, VT 5042 EKP)
- Umluftofen (Heraeus, LUT 6050 LAF)
- Wafersäge (Disco, DAD-2H/6TM)
- Anodischer Bonder (Karl Süss KG, SB6)
- Entwicklungsbank (Arias)
- Digestorium (Sonderarbeitsfläche)

Kontakt:

Hochschule Kaiserslautern
Amerikastraße 1
66482 Zweibrücken

Prof. Dr. Monika Saumer
monika.saumer@hs-kl.de
T +49 631 3724-5420

Dipl.-Ing. (FH) Detlev Cassel
detlev.cassel@hs-kl.de
T +49 631 3724-5448

Messtechnik

- Mikroskope (Olympus Corporation, BX50, BX51, BX41M, BX41M-LED)
- Schichtdickenmessgerät mit UV/VIS-Lichtquelle (Filmetrics Europe GmbH, F20-UV; Hamamatsu Photonics K.K., L10290)
- Wafer-Prober mit Parameteranalyzer (Karl Süss KG, AP6; Keithley Instruments Corporation, 4200-SCS)
- Partikelzähler (Met One, 2048)
- He-Lecksucher (Balzers Instruments, HLT260)



<https://www.hs-kl.de/ims>